

I. 概 要

1. 沿 革

昭和 5 年 4 月	長崎県窯業指導所を波佐見町に設立
昭和 22 年 3 月	長崎県美術工芸陶磁器研究所を佐世保市三川内町に設立
昭和 30 年 11 月	長崎県美術工芸陶磁器研究所を長崎県窯業指導所へ統合
昭和 40 年 6 月	長崎県窯業技術センターと名称変更
昭和 46 年 4 月	長崎県窯業試験場と名称変更
平成 4 年 4 月	現在地へ移転し、長崎県窯業技術センターと名称変更
平成 23 年 4 月	組織を改組し、総務課、研究企画課、環境・機能材料科、陶磁器科、戦略・デザイン科を設け、現在の 2 課 3 科制とする

2. 業務内容

陶磁器産業及び無機材料関係の産業を支援するために、研究開発・技術相談・依頼試験・人材養成・情報発信などの業務を実施している。

(主な業務)

(1) 研究業務

陶磁器産業を支援するため、ライフスタイルや社会情勢の変化に対応した、競争力のある製品開発・技術開発を行っている。また、新事業を創出することを目的として、新素材や新プロセスを用いた製品を開発している。さらに、産学官との共同研究により開発のスピードアップを図っている。

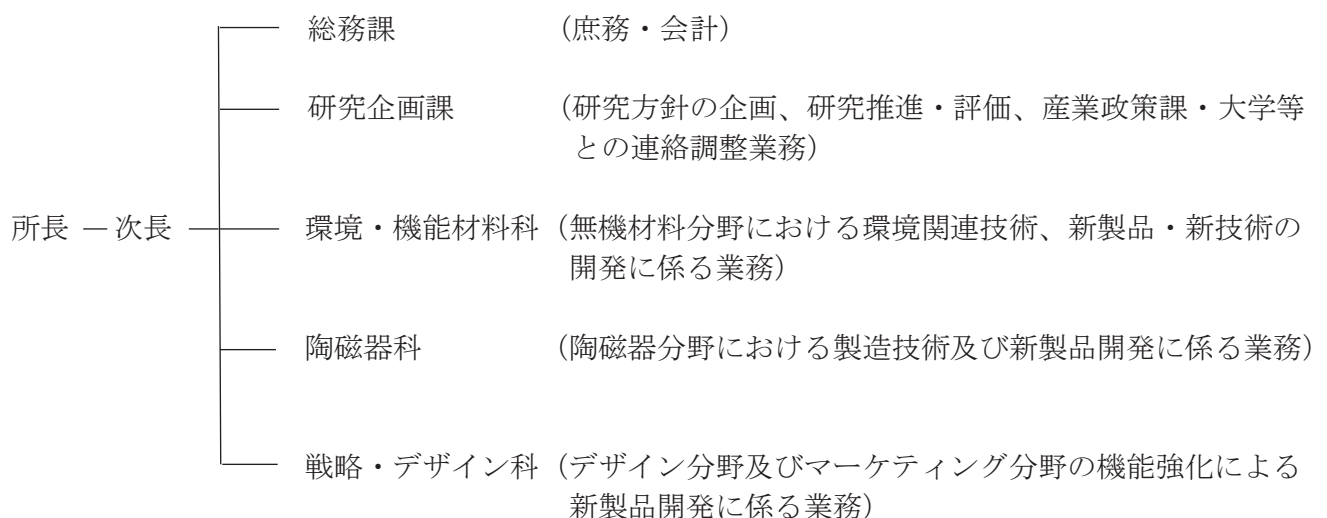
(2) 技術支援

陶磁器、デザイン及び無機材料全般に関する技術相談に応じている。また、製品試作や研究に必要な設備機器の開放を行っている。さらに、人材養成のための各種研修や情報提供を実施している。

(3) 依頼試験

企業や団体等からの依頼による、各種材料や製品の分析・測定・機能に関する試験を実施している。

3. 組 織 (令和 8 年 4 月 1 日現在)



4. 職員の配置・職員名簿（令和8年4月1日現在）

職員配置表

職 員	配置状況（現員数）							
	全体	所長	次長	総務課	研究企画課	環境・機能材料科	陶磁器科	戦略・デザイン科
事務吏員	3	1		2				
技術吏員（研究員）	12(3)		1		1(3)	3	3	4
技術吏員（技 師）	3					1	2	
会計年度任用職員（非常勤）	4			2		1		1
計	22(3)	1	1	4	1(3)	5	5	5

（ ）内は兼務

職員名簿

所 属	職 名	氏 名
	所 長	園 田 貴 子
	次 長	吉 田 英 樹
総 務 課	課 長	山 口 美津子
	係 長	五反田 久
	会計年度任用職員	山 口 里 美
	会計年度任用職員	山 口 紀 子
研究企画課	課 長（兼）	吉 田 英 樹
	主任研究員	永 石 雅 基
	主任研究員（兼）	浦 郷 寛 康
	主任研究員（兼）	中 尾 杏 理
環境・機能材料科	科 長	山 口 典 男
	専門研究員	秋 月 俊 彦
	主任研究員	浦 郷 寛 康
	技 師	木 須 一 正
	会計年度任用職員	増 元 秀 子
陶 磁 器 科	科 長	河 野 将 明
	専門研究員	狩 野 伸 自
	専門研究員	高 松 宏 行
	技 師	山 口 英 次
	技 師	岩 永 省 吾
戦略・デザイン科	科 長	依 田 慎 二
	主任研究員	中 尾 杏 理
	研 究 員	石 原 恒 平
	研 究 員	桐 山 有 司
	会計年度任用職員	石 原 靖 世

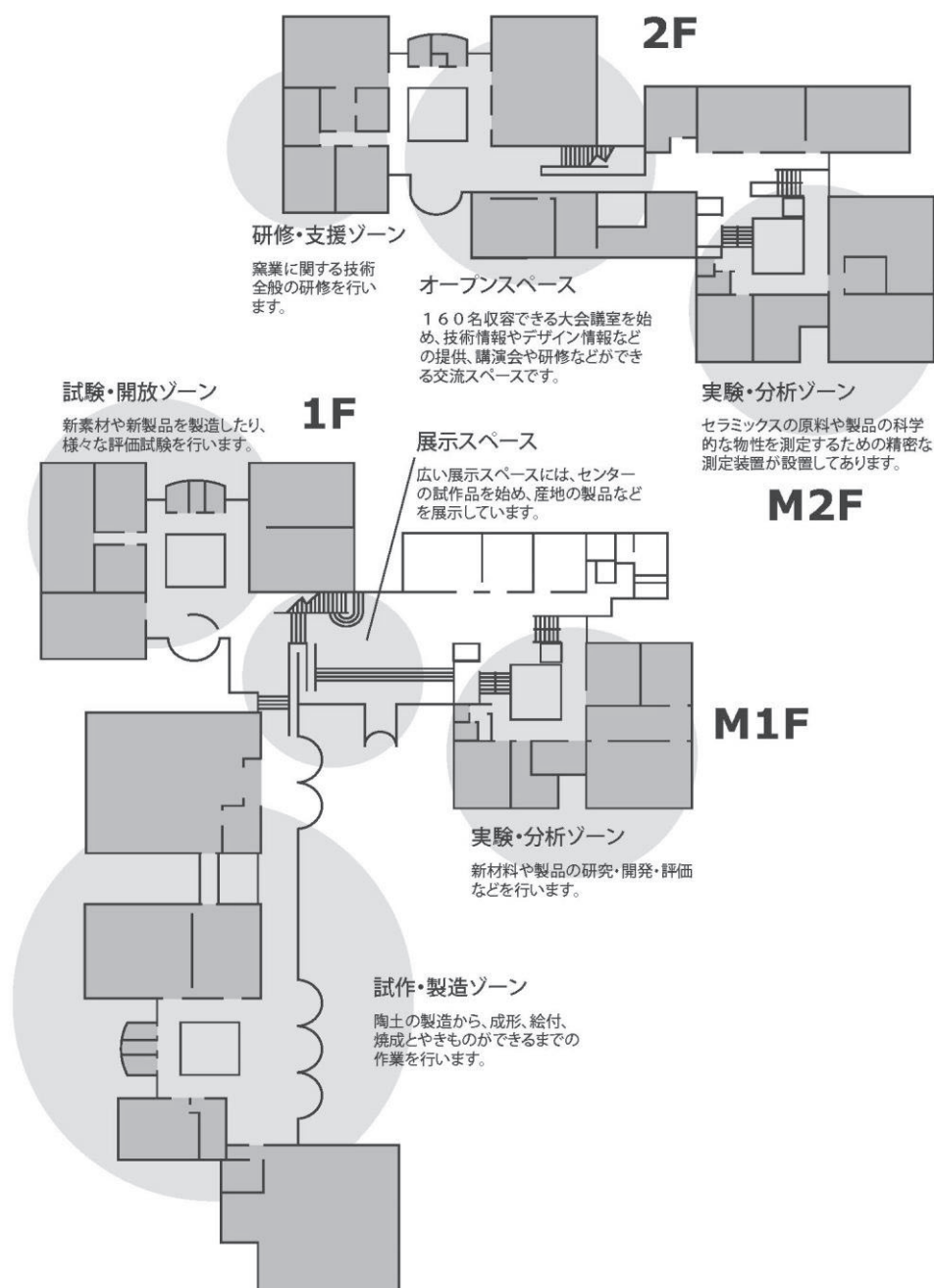
5. 令和7年度決算

(単位：円)

事業名	決算額	備考
窯業技術センター運営費	81,265,017	
依頼試験費	903,378	
技術人材養成事業	793,095	
試験研究費	5,831,618	(本課執行備品購入費は含まない)
戦略プロジェクト研究推進事業	483,000	
長崎県知的財産活用推進事業	771,000	
政策デザイン会議	10,620	
総務管理費等	1,103,438	
合 計	91,161,166	

6. 土地・建物（令和8年4月1日現在）

- (1)敷地面積 20,848m²
- (2)建物延面積 5,693m²
- (3)構造 鉄筋コンクリート2階建
- (4)配置図



7. 主要設備・機器

名 称	型式・仕様・機能	製作所名	設置 年度
携帯用マイクロスコープ	VHX-100N 倍率：25 倍～ 175 倍又は 150 倍～ 800 倍	キーエンス	H15
赤外線サーモグラフィー	CPA-8200 測定温度範囲：-40℃～ 1,500℃ 最小温度分解能：0.08℃～ 0.1℃	チノー	H16
ローラーマシン	UR-50 最大石膏型寸法：深さ 200mm(内鋳) 高さ 150 mm(外鋳)	高浜工業	
真空凍結乾燥機	FZ6CS 除湿量：6L、ストラップ 乾燥温度：-80℃	LABCONCO	H17
フーリエ変換赤外分光光度計	FT/IR-6100ST 測定範囲：7800 ～ 350 cm ⁻¹	日本分光	H18
気孔径分布測定装置	PORE MASTER 60GT 水銀圧入式 測定範囲：3.6nm ～ 426 μm	カンタクロム	H19
クリープメータ自動解析装置	CA-3305 測定変形範囲 0.01 ～ 19.99mm 測定応力範囲 1 ～ 1999g	山電	
原子吸光光度計分析システム	ICE 3500Z フレーム、ファーンネス対応	サーモフィッシャー サイエンティフィック	H21
耐火度試験機	小型超高温炉 LPG+O ₂ ガスによる直接炎加熱方式	戸田超耐火物	
エネルギー分散型 X 線分析装置	Noran system7 検出範囲 Be～U	サーモフィッシャー サイエンティフィック	
テフロン内筒型反応容器	TAF-R1500型 最高使用温度180℃ 使用圧力10MPa、容積1500cm ³	耐圧硝子工業	
色彩輝度計	BM-5AS 測定輝度範囲：0.007～1,760cd/m ²	トプコンテクノハウス	H22
圧力鋳込み装置	1T80-1・1T60-1・1T45-1 大型、中型、小型（可動式）	圭成鉄工	
自動乳鉢	石川式攪拌播潰機型式 24 小型磁製乳鉢（24 号）	石川工場	
3次元設計システム	モデリングソフトウェア Free Form Modeling Plus with Phantom Desk top	センサブルテクノロジーズ (SensAble Technologies)	
大型 3Dモデリングマシン	MM-1000 軸の動作範囲：1000(X)×600(Y)× 350(Z)mm	岩間工業所	H23
減圧蒸留濃縮装置	VSU-5 蒸発容器容量：5L	清水理化学機器製作所	
赤外線水分計	FD-720 測定方式：加熱乾燥・質量測定方式	ケット科学研究所	
卓上加工機	mini-CNC HAKU 2042 動作範囲：203.5(X)×425(Y)× 68.8(Z)mm	オリジナルマインド	

名 称	型式・仕様・機能	製作所名	設置 年度
可搬型デジタルマイクロスコープ	P-400R 最大倍率 400 倍、コードレスで観察可能	ニコン	H24
スクロールコンプレッサ	定格出力：0.75 馬力 制御圧力：0.6～0.8MPa 吐出し空気量：74L/min 以上	アネスト岩田	
5 軸モデリングマシン	MM-700 R5 軸 の 動 作 量 ： 450(X) × 660(Y) × 420(Z)mm/±100 度(A)/360° (C)	岩間工業所	H25
冷熱衝撃試験機	TSE-11-A 温度域：-65～0℃、60～200℃ テストエリア：W320×D230×H148mm 試料重量：～2kg	エスペック	H26
押出成形機	FM-P30 混練・真空脱気・押出機能一体型 スクリュー径 30mm	宮崎鉄工	
X線透過式粒度分布測定装置	SediGraph III PLUS 測定可能範囲：300 μm～0.1 μm	マイクロメリティックス	
X線回折装置	EMPYREAN 管電圧 45kV、管電流 40mA 管球 Cu (銅)	スペクトリス	
走査型電子顕微鏡	JSM-7100F ショットキー電界放出形電子銃 二次電子分解能 1.2nm (30kV)	日本電子	
元素分析計	FLASH2000 炭素、窒素、水素同時分析 試料室：数 mg、精度 0.2%	サーモフィッシャー サイエンティフィック	
コーン貫入自動載荷装置	ST-705 試験方法：JIS A 1288 に準拠	札幌谷藤	
土の自動突き固め試験機	JIS A 1210 S-174 型	西日本試験機	H27
遠赤外線分光放射率計	FIR-1002 測定温度：50 ～ 200℃、 波長範囲：3.3 ～ 20μm	サーモフィッシャー サイエンティフィック	
レーザー回折式粒度分布測定装置	マスターサイザー 3000 測定範囲：0.01 ～ 3500μm 懸濁液、エマルジョン及び乾燥粉体	スペクトリス マルバーン事業部	H28
X線分析顕微鏡	XGT-7200V X 線照射径：φ 10μm 測定元素：Na ～ U	堀場製作所	
高精度 3D プリンタ	Objet Eden260VS 積層ピッチ：16 μm 又は 30 μm 造形サイズ：(X) 255 × (Y) 252 × (Z) 200mm モデル材料：アクリル系硬質樹脂他	ストラタシス	

名 称	型式・仕様・機能	製作所名	設置 年度
視感透過率測定器	TLV-304-LC 視感度フィルターφ25mm 測定再現性:±0.5%以内 測定光束:φ6mm	朝日分光	H29
ガス置換管状電気炉	TMF-500N 温度設定範囲:100～1200℃ セラミックス管:φ40×500mm	アズワン	
セラミックトナー印刷システム	SP C420e 特別仕様(無機顔料トナー用 ICC プロファイル設定) 印刷解像度:600×600dpi 印刷用紙サイズ:A4	サンリユウ	
熱分析装置	Thermo plus EV02 TG-DTA8121 高温型(～1500℃) DSC8231 標準型(～725℃) TMA8311 高温型(～1500℃)	リガク	
イオンクロマトグラフ	IntegrionRFIC 溶離液自動調整機能付 オートサンプラー陽、陰イオン有機酸 成分の分析可能	サーモフィッシャー サイエンティフィック	
ポータブル3Dスキャナ	HandyScan700 精度:最大0.030mm 測定可能範囲:0.1～4m	アメテック	
電気炉	KNE-18 最高温度1300℃(酸化焼成) 炉内寸法幅850mm 高さ700mm 奥行 500mm	九州熱学	H30
蛍光X線分析装置	Zetium 測定対象元素ホウ素(B)～ ウラン(U)、マッピング機能、0.5mm の微小部測定	スペクトリス	
ネオクールアスピレーター	CF800P	ヤマト科学	
インキュベーター	冷凍機付インキュベーター MIR-554-PJ 内容量406L	PHC	
海洋付着物観察システム	Under water Drone Camera TITAN	エポックワールド	H31
万能試験機	オートグラフ AGX-20kNV	島津製作所	
熱機械分析装置	TMA 測定方式:示差膨張方式 測定温度範囲:室温～950℃	リガク	
粉末固着式3Dプリンタ	ProJet360 造形範囲 X203 mm Y254 mm Z203mm	3DSYSTEMS	
酸化・還元雰囲気可変電気炉	KNE-30D 最高温度1300℃(酸化・還元) 炉内寸法 幅780mm 高さ800mm 奥行850mm	九州熱学	
恒温恒湿器	HISPEC HT310	タバイエスペック	

名 称	型式・仕様・機能	製作所名	設置 年度
NCローラー成形機	URM125NC 成形品サイズ:外鍍皿類 φ 300mm 内鍍 φ 140mm×H140mm	高浜工業	R2
イオン濃度測定システム	LAQUA F-73S, 銀イオン電極	堀場製作所	
自記分光光度計	UH5700 波長範囲:190～3300nm	日立ハイテクサイエンス	
乾式自動密度計	Accupyc II 1340 セル容積:10 cm ³ 3.5 cm ³ 1 cm ³	マイクロメリティックス	
X線断層撮影装置	NAOMi-CT 3D-L 最大測定可能サイズ φ 251×185mm	アールエフ	
ディープラーニングシステム	SENSE-FB02 Windows10Pro, Core i9-10980EX GeForce RTX 3090、メモリ 128GB	iiyama	
重量変化計測システム	GH-252 秤量(g)101/250 最小表示 (mg) 0.01/0.1	エー・アンド・デイ	
超音波洗浄機	LSC-63D 大型二周波超音波洗浄器 (分離型) 槽内寸法 (mm) 500×350×360 発振周波数:28/20kHz	アズワン	R3
特定小型電力無線機器	ワイヤレスシステム ダイバシティワイヤレスチューナー ダイバシティワイヤレスユニット ワイヤレスマイク (ハンド型) ワイヤレスマイク (タイピン型) 壁取付用ワイヤレスアンテナ ワイヤレスアンプ	TOA	
デジタル粘度計	LVDV1M B型回転粘度計 RTD温度プローブ及びプローブクリップ含む	ブルックフィールド	
版下出力装置	サーマルディジプレートシステム TDP-580 出力範囲 558×220 ～ 775mm 出力解像度 1200dpi	三菱製紙	
分光測色計	CM-3700A 波長範囲 400～700nm	コニカミノルタジャパン	
除湿乾燥機	PV-332 温度制御範囲:室温 +20 ～ 200℃	エスペック	
全自動ガス吸着装置	BELSORP MAX-12 比表面積、細孔分布、蒸気吸着測定	マイクロトラック・ベル	

名 称	型式・仕様・機能	製作所名	設置 年度
オスミウム蒸着装置	OPC80T-LM オスミウム薄膜成膜モード 0～999nm	フィルジェン	R4
ファイバー焼成炉	SC-05-GB 最高温度 1350℃ 炉内容積 0.5m ³	清水築炉	
ファイバ型放射温度計	FTKX-TNE0240-1000S101-000 温度範囲：240-2000℃ 測定距離：1000mm	ジャパンセンサー	
COガスセンサー	RI-557 検知対象ガス：可燃性ガス / CO / CO ₂ 検知範囲：CO:0-10vol%、CO ₂ :0-100vol%	理研計器	
移動型デジタルビデオカメラ	THETA SC2 静止画、動画(4K、2K)、音声(モノラル)撮影 内蔵メモリ 14GB	RICOH	
インターロッキングブロック 試験機	KC-344 試験形状 100mm x 200mm、300mm x 300mm 用 メスシリンダー容量 200cc	関西機器製作所	
送風定温乾燥機	WFO-520 強制対流方式 温度調節範囲 室温+10～270℃	東京理科器械	R5
モデリングマシン	MM650 neo-sp 軸動作範囲 650(X)×450(Y)× 200mm(Z) CAM ソフト:OneCNC XRq Mill Expert	岩間工業所	
レーザー加工機	Speedy100C-8063 レーザー出力：60W 加工エリア：W608 (X 軸) ×D303 (Y 軸) mm	トロテック・レーザー・ジャパン	
水分量計測システム	MS-70 水分率最小表示：0.001% 測定温度範囲：30～200℃	エー・アンド・デイ	
定温乾燥機	DX402 自然対流方式 温度制御範囲：室温+5～300℃	ヤマト科学	
AI 解析用ノートパソコン	Vector GP68HX12VH779JP Core i9, 16GB, 1TB, 16 インチ GeForce RTX 4080	MSI	
画像解析用パソコン	LEVEL-779-LC147KF-UL1X Windows 11 Home, Core i7-14700KF GeForce RTX 4070 Ti	iiyama	
AI 解析ボード	Jetson Nano 開発者キット B01 GPU:128 コア Maxwell CPU:4Core ARM A57、メモリ：4GB	NVIDIA	
IoT ボードコンピューター	LattePanda 3 Delta CPU: Intel Celeron N5105 メモリ：8GB、ストレージ：64GB	DFROBOT	

名 称	型式・仕様・機能	製作所名	設置 年度
XRD制御システム	本体 (DY1560) 制御用 粉末回折データベース ICDD PDF-2	スペクトリス	R6
アイトラッカー	サンプリングレート 100Hz 近遠視調整可能	トビー・テクノロジー	
オートファインコーター	JEC-3000FC ターゲット : Pt, Au, Au-Pd, Pt-Pd 試料回転傾斜装置付属	日本電子	
大判プリンタ	SC-P9550PS インクジェット方式 最高解像度 : 2400dpi × 1200dpi	エプソン販売	
小型電気炉	KNE-5.5 常用使用温度 1280℃ 炉内寸法 W380 × D380 × H380mm	九州熱学	
COガスセンサー	RI-557 検知対象ガス : 可燃性ガス / CO / CO ₂ 検知範囲 : CO:0-10vol%、CO ₂ :0-100vol%	理研計器	
陶芸窯焼成管理システム	WD100-N32 (データ収集サーバ) WD100-FA02 (温度計測ユニット) 熱電対タイプ : B, E, J, K, N, R, S, T	アイエスエイ	
粘度計	TVB-10M 回転速度、段数 : 0.3-100rpm、18 段 粘度表示 : % / mPa・s / Pa・s / kPa・s	東機産業	R7
デジタルマイクロスコープ	DSX2000 高解像チルトモデル 総合倍率 : 27 ~ 3,855	エビデント	
フレイムボンド	FB-5 対象素材:プラスチック、金属、ガラス、セラミック、木質、ゴム等	ソフト 99 コーポレーション	
FFF方式3Dプリンタ	RAISE3D E2 造形範囲 295 × 240 × 240 mm 積層ピッチ 0.02 ~ 0.65 mm	Raise 3D Technologies	
COガスセンサー	RI-557 検知対象ガス : 可燃性ガス / CO / CO ₂ 検知範囲 : CO:0-10vol%、CO ₂ :0-100vol%	理研計器	
過熱水蒸気オーブンレンジ	ER-D7000B 加熱方式 石窯ドームオープン オープン温度 100 ~ 300℃・350℃ 内容量 30L	東芝	
小型レーザー加工機 (卓上)	LASER-DAJADJ6PRO レーザー出力 : ダイオードレーザーモジュール 10W, 5W ファイバーレーザーモジュール 1W 加工エリア : W100 (X 軸) × D100 (Y 軸) mm	Dongguan Diaojiang Technology Co., Ltd.	

8. 依頼試験手数料

令和 8 年 4 月 1 日現在

(単位：円)

項 目		手数料単価	備 考	項 目		手数料単価	備 考
耐火度		2,200	1 件	※ 内 訳	X 線 回 折	1,760	チャート紙のみ
吸水率		770	〃			3,520	解析つき
収縮率		1,430	〃		偏 光 顕 微 鏡	1,760	1 試料
定性分析		4,290	1 試料		電 子 顕 微 鏡	5,720	試料作製が容易なもの
定量分析		2,970	1 成分			7,150	試料作製に時間を要するもの
※ 応 用 試 験 1 件		770～ 8,360				8,030	成分分析を要するもの
※ 内 訳	粒 度 試 験	1,320	篩分析含む		気 孔 径 分 布	3,740	1 試料
	ベ ン ド	2,090			焼 成 試 験	1,870～ 8,360	別表
	熱 膨 張	2,530	～950℃		衝 撃 強 さ	1,320	
	熱 分 析	2,640	示差熱・熱天秤・熱膨張 ～1,400℃		ば ち 試 験	2,310	
	オートクレーブ	1,870			耐 薬 品 性 試 験	2,420	耐酸性・耐アルカリ性
	熱 衝 撃 強 さ	1,760			光 沢 度 測 定	770	1 件
	比 表 面 積	5,170			タイルの寸法測定	2,310	長さ、幅、厚さ、裏あしの高さ
	曲 げ 強 さ	2,530			溶出試験 (鉛またはカドミウム)	2,200	・食品衛生法に基づくもの ・1 試料 3 点 (検体) まで
	見 掛 気 孔 率	1,100					
	カ サ 比 重	1,100			輝 度 測 定	1,540	1 時間以内
	真 比 重	2,530	1 試料 1 点			4,070	1 時間を超える
	圧 縮 強 さ	1,540			◎加 工 調 整	1,210 ～ 25,630	原材料等調整 (別表)
	遠赤外線放射率	4,510	40～200℃	図案調整 (別表)			
	白 色 度	1,210		製品設計 (別表)			
	鑄込泥漿調整		1,430	粘度測定含む	成績証明書謄本交付手数料		400

(別表)

焼成試験			
ガ ス 窯	容積(m ³)	条件	
		素焼	本焼
	0.1	2,860	3,740
	0.2	3,850	5,390
	0.5	5,830	8,360
電 気 炉	出力(kW)	条件	
		素焼	本焼
	10 未満	1,870	2,860
	10 以上 20 未満	3,080	4,400
	20 以上	—	7,700

◎加工調整		
原 材 料 等 調 整	短い	1,210
	1 日程度	2,860
	1 日～5 日以内	5,390
	5 日超	25,630
図案 調整	1 日以内	1,320
製 品 設 計	P C によるデータ加工 (1 時間あたり)	4,290
	3 D C A D による製品設計	4,510
	視覚デザイン	4,510

9. 開放設備使用料

令和8年4月1日現在

機 器 名	用 途		設置部屋名	使用料 (円/時間)
ジョークラッシャー	製 土 関 係	陶石などの粗粉碎	乾 式 粉 碎 室	330
ロールクラッシャー		〃 中粉碎	〃	220
スタンプミル		〃 微粉碎（乾式）	〃	440
ボールミル（20 kg～100 kg）		セラミックスの微粉碎（湿式・乾式）	湿 式 粉 碎 室	330
振動ミル（20 ㍑）		〃 〃 （ 〃 ）	〃	440
アクワマイザー		〃 〃 （ 〃 ）	〃	660
ポットミル		〃 〃 （ 〃 ）	〃	110
フィルタープレス		5 kg～20 kg程度の原料を脱水	〃	440
振動篩		水簾した原料を分級	〃	110
真空土練機		陶土を練り気泡を抜く	〃	550
除鉄機		原料の鉄分を取り除く	〃	440
卓上型ニーダー		高粘性坯土の混練	新素材実証試験室	110
攪拌装置		鑄込み泥漿の攪拌	試 作 成 形 室	110
自動乳鉢		絵具などの微粉碎	絵 付 室	110
原料混合機		原料の混合	湿 式 粉 碎 室	110
万能攪拌機		加熱・減圧下での原材料の混合・攪拌	新素材実証試験室	110
遊星型ボールミル		セラミックスの微粉碎（湿式・乾式）	絵 付 室	110
石膏型ロクロ	石 膏 型 関 係	石膏型の成形用・原型用	石 膏 成 型 室	110
真空攪拌機		石膏スラリーの攪拌・脱気	〃	110
ボール盤		石膏型等の穴あけ加工用	〃	110
平面研削盤		石膏型の平面（平行）研削加工	〃	110
3D モデリングマシン		切削加工による石膏型の作製 （加工動作範囲（mm）：400×400×155H）	デジタル造形室	3,410
大型 3D モデリングマシン		切削加工による石膏型の作製 （加工動作範囲（mm）：1050×650×380H）	〃	4,290
5 軸モデリングマシン		切削加工による石膏型の作製 （加工動作範囲（mm）：450×660×420H）	〃	5,060
機械ロクロ	成 形 関 係	各種試作品の機械ロクロ成形	試 作 成 形 室	880
乾燥機（ハイテンプオーブン）		型などの温風乾燥	石 膏 成 型 室	110
乾燥機（内容量 350 ㍑）		生地や顔料の温風乾燥（200℃以下）	絵 付 室	110
押出し成形機		パイプや棒状の成形体を練土の状態で作る	新素材実証試験室	660
ローラー成形機		厚さ 10mm～20mm、巾約 30 cm～40 cmの陶板作製	湿 式 粉 碎 室	110
球形整粒機		押し出し品の転動による球形整粒	新素材実証試験室	220
単軸造粒機		セラミックスの押し出し造粒	〃	110
高速混合造粒機		乾粉を転動により造粒	製 土 室	330
小型試料成形機		静水圧により試料の成形	材 料 試 験 室	440
新型ローラーマシン		碗類の自動成形（ヘッドのスライド可能）	試 作 成 形 室	330
N C ローラー成形機		碗類の自動成形（ヘッドの N C 制御可能）	電 気 炉 室	1,540
除湿乾燥機		石膏型や生地などの温風乾燥	試 作 成 形 室	220
圧力鑄込み装置（大）		試作品の圧力鑄込成形 （型の設置寸法（mm）：800×800）	湿 式 粉 碎 室	220
圧力鑄込み装置（中）		〃 （型の設置寸法（mm）：600×600）	〃	110
圧力鑄込み装置（小）		〃 （型の設置寸法（mm）：450×450）	〃	110
回分型反応装置		顔料の合成	絵 付 室	110

機 器 名	用 途		設置部屋名	使用料 (円/時間)
スクリーン印刷機（手動）	デザイン関係	スクリーンによる転写紙の印刷、転写	加 飾 研 究 室	660
三本ローラー		絵具や顔料の粉碎	〃	110
サンドブラスト機		砂を噴射して、器物の表面をレリーフ加工	工 作 室	330
版下出力装置		コンピュータにより版下を作製	加 飾 研 究 室	2,750
高精度 3D プリンタ		3DCAD データの樹脂による出力	デジタル造形室	2,530
ポータブル 3D スキャナ		物体を数値化した 3D データに変換	〃	1,430
粉末固着 3D プリンタ		3DCAD データの粉末固着による出力	〃	1,210
FFF 方式 3D プリンタ（材料持込）		3DCAD データの ABS または PLA による出力（指定材料を事前持込）	デ ザ イ ン 室	110
FFF 方式 3D プリンタ（材料持込なし）		3DCAD データの ABS または PLA による出力（材料料金含）	〃	220
デジタル膜圧計		版や印刷物の厚み測定	加 飾 研 究 室	110
大判プリンタ		B0 サイズまでの大判プリント出力	デ ザ イ ン 室	4,840
電気炉（10kW 未満）	焼 成 関 係	テストピースの焼成試験用	デジタル造形室	220
電気炉（10kW 以上）		製品の焼成試験用（約 1,300℃まで）	〃	660
電気炉（1,000℃以下）		テストピースの焼成試験用（1,000℃まで）	技 術 研 修 室	110
高温電気炉		アルミナなどの焼成（約 1,600℃まで）	電 気 炉 室	770
フリット溶解炉		ガラスの製造（約 1,400℃まで）	〃	660
小型熱処理炉		急熱急冷試験や小さい試料の焼成	〃	220
可変雰囲気炉		真空及び水素雰囲気等で焼成（約 1,700℃まで）	〃	2,310
自動焼成ガス炉（0.1m ³ ）		テストピース及び製品の焼成	焼 成 室	770
〃（0.2m ³ ）		〃	〃	770
〃（0.5m ³ ）		〃	〃	1,210
還元用電気炉		〃	〃	1,320
大型陶板用ガス窯		大型陶板（約 110 cm 角）焼成用	〃	2,090
放電プラズマ焼結装置		直流パルス放電による粉体の迅速な焼結	電 気 炉 室	2,090
曲げ強度試験機	試 験 関 係	陶磁器用材料等の曲げ強さの測定	材 料 試 験 室	990
摩耗試験機		釉薬や上絵具面等の摩耗性について試験	デジタル造形室	330
摩耗試験機（落砂式）		〃	〃	110
耐圧試験機		レンガや陶磁器製品の圧縮強度の測定	材 料 試 験 室	330
衝撃試験機		陶磁器製品のインパクトチップング試験	〃	440
耐凍害性試験機		建築用粘土製品の凍害に対する抵抗性を観察	〃	110
耐電圧試験機		電気用品安全法に基づく絶縁耐圧の試験	暗室スタジオ室	0
自記分光光度計	計測・評価 関係	絵具、顔料のスペクトル測定	第 2 機器分析室	330
分光測色計		焼成品の白さや色調測定	技 術 研 究 室	330
赤外分光光度計		原料や有機材料の成分測定	第 2 機器分析室	880
遠赤外線分光放射計		セラミックスからの放射エネルギー測定	電 子 顕 微 鏡 室	2,420
偏光顕微鏡		鉱物などに含まれる結晶形態の観察	暗室スタジオ室	110
自動密度計		生原料や焼成粉末原料の密度を測定	第 1 物性測定室	330
全自動ガス吸着測定装置		粉体の表面積を測定	〃	1,540
熱分析装置		陶土や原料の加熱変化の測定	〃	660
熱伝導率測定装置		材料の熱伝導率の測定	製 品 試 験 室	220
色彩輝度計		発光体の輝度を測定	暗室スタジオ室	330
元素分析計		粉体に含まれる炭素窒素の測定	第 2 物性測定室	2,420
微小ビッカース硬度計		釉薬等の硬さ測定	技 術 研 究 室	110
ゼータ電位測定装置		粉体の表面電荷の測定	第 1 物性測定室	990

機 器 名		用 途	設置部屋名	使用料 (円/時間)
粉末X線回折装置	計測・評価 関係	原料の種類や成分測定	X 線 室	1,760
原子吸分光光度計分析システム		鉛・カドミウムの測定	製 品 試 験 室	1,100
pHメーター（試料調整含む）		泥漿などのペーハーを測定	材料開発実験室	770
pHメーター（試料調整無し）		〃	〃	110
細孔分布測定器		石膏等多孔質材の孔の大きさ及び割合の測定	〃	1,540
熱膨張計		焼成した素地、釉薬の熱膨張を測定	第3物性測定室	770
レーザー回折式粒度分布測定装置		粉体粒子の大きさや割合を迅速に測定	〃	880
X線透過型粒度分布測定装置		陶土・釉薬等の粒子の大きさや割合を測定	〃	770
走査型電子顕微鏡		製品内部や粒子形状を拡大し観察	電 子 顕 微 鏡 室	3,080
走査型電子顕微鏡用エネルギー分散型X線分析装置		微小領域の元素分布と分布状況を測定	〃	1,760
オートクレーブ		絵具などの安定性試験	材 料 試 験 室	770
鉛筆硬度試験器		釉薬の表面硬度の測定	デジタル造形室	110
可塑性測定装置		陶土の粘性や可塑性を測定	技 術 研 究 室	660
デジタルマイクロスコープ		製品の表面を拡大し観察	〃	990
蛍光X線分析装置		試料の定性、定量分析	第2機器分析室	3,190
デジタル変角光沢計		磁器の表面の光沢度を測定	暗室スタジオ室	0
赤外線サーモグラフィ		製品の表面温度をカラー画像で観察	〃	220
X線分析顕微鏡		光学顕微鏡による観察と元素分析及び分布状態測定	X 線 室	1,650
イオンクロマトグラフ		溶液中のイオン成分の定量分析	第2機器分析室	2,090
X線断層撮影装置		製品や素材内部を非破壊で観察	X 線 室	440
オスミウム蒸着装置		SEM観察試料への導電性皮膜の蒸着	電 子 顕 微 鏡 室	660
旋盤	工作・加工 関係	工具などの平面研削加工	工 作 室	550
ダイヤモンドカッター		素地など高精度切断	〃	440
フライスボール盤		金属や焼成品の穴あけ加工	〃	220
ノコ盤		ロクロ用ヘラ作製などの切断	〃	660
セラミック用オビノコ		セラミックスなどの切断	〃	330
マルターカッター		測定用試料などの切断	〃	110
マイクロカッター		小さな原料や材料の精密切断	耐 火 度 試 験 室	110
グラインダー		各種試料の面出し・粗研磨	電 子 顕 微 鏡 室	220
ダイヤ液噴射装置		高精度研磨機にダイヤモンド砥粒の自動供給	〃	770
琢磨機		測定用試料の鏡面仕上げ	〃	880
高精度研磨機		測定用試料の研磨仕上げ	〃	220
小型レーザー加工機		レーザーによる素材の切断や表面加工	加 飾 研 究 室	220
レーザー加工機		〃	〃	1,100